

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成20年5月15日(2008.5.15)

【公表番号】特表2007-532900(P2007-532900A)

【公表日】平成19年11月15日(2007.11.15)

【年通号数】公開・登録公報2007-044

【出願番号】特願2007-508368(P2007-508368)

【国際特許分類】

G 01 F 1/32 (2006.01)

【F I】

G 01 F 1/32 L

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月27日(2008.3.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

流体の流量を計測するための渦流量計であって、

流体を運ぶための導管、

導管の一部にある厚みを減らした領域、

導管中に配置され、厚みを減らした領域に結合され、流体の流量に応答して、厚みを減らした領域に対し、ピボットラインを中心とする揺動を加えるように構成された放出バー、及び

厚みを減らした領域にあり、流体の流れに対して平行に延びる少なくとも一つの補強リブ

を含む渦流量計。

【請求項2】

補強リブが、厚みを減らした領域の一方の側で、ピボットラインに対して平行に配置されている、請求項1記載の渦流量計。

【請求項3】

少なくとも一つの補強リブに対してピボットラインの反対側に配置され、流体の流れに対して平行に延びる第二の補強リブをさらに含む、請求項2記載の渦流量計。

【請求項4】

厚みを減らした領域に結合されてその動きを感じて流量を示す出力を提供するためのセンサをさらに含む、請求項1記載の渦流量計。

【請求項5】

少なくとも一つの補強リブが、ピボットラインと厚みを減らした領域の縁との間のほぼ中間点に配置されている、請求項1記載の渦流量計。

【請求項6】

ピボットライン上に配置され、流体の流れに対して平行に延びる中心リブをさらに含む、請求項1記載の渦流量計。

【請求項7】

導管の外側に配置され、中心リブに結合された支柱をさらに含む、請求項6記載の渦流量計。

【請求項8】

支柱に結合されてその動きを感じて流量を示す出力を提供するためのセンサをさらに含む、請求項 7 記載の渦流量計。

【請求項 9】

少なくとも一つの補強リブが、厚みを減らした領域の厚さにほぼ等しい高さを有する、請求項 1 記載の渦流量計。

【請求項 10】

少なくとも一つの補強リブが厚みを減らした領域の縁から縁まで延びる、請求項 1 記載の渦流量計。

【請求項 11】

流体の流量を測定するための渦流量計であって、
流体を運ぶための導管、
導管の一部にある厚みを減らした領域、
導管中に配置され、厚みを減らした領域に結合され、流体の流量に応答して、厚みを減らした領域に対し、ピボットラインを中心とする揺動を加えるように構成された放出バー、及び
厚みを減らした領域の縁から縁までピボットラインに対して平行に延びる少なくとも一つの補強リブ
を含む渦流量計。

【請求項 12】

厚みを減らした領域に結合されてその動きを感じて流量を示す出力を提供するためのセンサをさらに含む、請求項 11 記載の渦流量計。

【請求項 13】

少なくとも一つの補強リブが、ピボットラインと厚みを減らした領域の周縁との間のほぼ中間点に配置されている、請求項 11 記載の渦流量計。

【請求項 14】

ピボットライン上に配置され、厚みを減らした区域に結合された中心リブをさらに含む、請求項 11 記載の渦流量計。

【請求項 15】

導管の外側に配置され、中心リブに結合された支柱、及び
支柱に結合されてその動きを感じて流量を示す出力を提供するためのセンサ
をさらに含む、請求項 14 記載の渦流量計。

【請求項 16】

センサに結合され、センサの出力を制御中枢に伝送するように適合された回路をさらに含む、請求項 11 記載の渦流量計。

【請求項 17】

少なくとも一つの補強リブに対してピボットラインの反対側に配置され、ピボットラインに対して平行に延びる第二の補強リブをさらに含む、請求項 11 記載の渦流量計。

【請求項 18】

流体の流量を計測するための渦流量計であって、
流体を運ぶための導管、
導管の一部に形成された厚みを減らした領域、
導管中に配置され、厚みを減らした領域に結合され、流体の流量に応答して、厚みを減らした領域に対し、ピボットラインを中心とする揺動を加えるように構成された放出バー、及び
厚みを減らした領域にある少なくとも一つの補強リブ
を含む渦流量計。

【請求項 19】

センサに結合され、センサの出力を制御中枢に伝送するように適合された回路をさらに含む、請求項 18 記載の渦流量計。

【請求項 20】

少なくとも一つの補強リブが、厚みを減らした領域の全長未満しか延びない、請求項18記載の渦流量計。

【請求項21】

ピボットライン上に配置され、厚みを減らした区域に結合された中心リブをさらに含む、請求項18記載の渦流量計。

【請求項22】

厚みを減らした領域が直径Dを有し、少なくとも一つの補強リブが、厚みを減らした領域の縁から0.25Dの距離に配置されている、請求項18記載の渦流量計。

【請求項23】

ピボットラインに対して平行に延び、少なくとも一つの補強リブ及びピボットラインからオフセットされている第二の補強リブをさらに含む、請求項18記載の渦流量計。

【請求項24】

少なくとも一つの補強リブ及び第二の補強リブがピボットラインの両側に配置されている、請求項23記載の渦流量計。

【請求項25】

少なくとも一つの補強リブ及び第二の補強リブが実質的に等しい量だけオフセットされている、請求項24記載の渦流量計。

【請求項26】

厚みを減らした領域が厚さを有し、少なくとも一つの細長い補強リブが、厚さにほぼ等しいような幅及び高さの寸法を有する、請求項18記載の渦流量計。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図1】

